

DNI OTWARTE MASZYN OPTYCZNYCH

17 lutego 2017 r.

Centrum Pomiarów Współrzędnościowych ZEISS ul. Wyzwolenia 26, Mikołów



Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty z optycznymi urządzeniami pomiarowymi, który odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 roku w Centrum Pomiarów Współrzędnościowych ZEISS. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

AGENDA

- 9:30 - 10:00 - rejestracja gości - poranna kawa
- 10:00 - 10:45 - prezentacja techniczna
- 10:45 - 11:30 - pomiary 3D na maszynie ZEISS O-INSPECT
- 11:30 - 12:15 - pomiary na projektorze 2D ZEISS O-SELECT
- 12:15 - 12:45 - przerwa na lunch
- 12:45 - 13:30 - pomiary za pomocą skanera ZEISS 3D COMET L3D
- 13:30 - 14:15 - pomiary za pomocą skanera ręcznego ZEISS T-SCAN
- 14:15 - 15:00 - mikroskopy ZEISS - badania jakościowe

Zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie
(tel.22 205 55 27)
lub mailem (katarzyna.piwowarska@zeiss.com)

Zaprezentowane zostaną następujące urządzenia:



ZEISS O-INSPECT 322

stykowo-optyczna maszyna pomiarowa

Maszyna O-INSPECT to maszyna posiadająca 2 głowice: stykową i optyczną. Wyposażona jest w zintegrowany interfejs kompensacji temperatury, czujnik pomiaru temperatury części oraz opcjonalnie palet podawczych z interfejsem pomiaru temperatury. Podstawa maszyny jest zintegrowana z pasywnym układem tłumienia drgań. Istnieje możliwość dozbudowania maszyny w sensor chromatyczny światła białego i/lub stół obrotowy.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy XYZ [mm]:	300 x 200 x 200
Dokładność pomiaru stykowego [m]:	od 1.6 +L/200 (głowica VAST XXT)
Dokładność pomiaru optycznego[m]:	od 1.6 +L/200 (głowica Discovery.V12)

ZEISS COMET L3D 2

skaner 3D ze stolikiem obrotowym

Ten niezwykle kompaktowy i lekki system może być łatwo przenoszony między miejscami wykonywania pomiarów bez większych trudności. Ponadto umożliwia prostą kalibrację na miejscu i zmianę pola pomiarowego poprzez prostą wymianę soczewek. To sprawia, że system jest gotowy do nowych zadań pomiarowych w krótkim czasie. Dzięki zminimalizowanej odległości roboczej (45-500 mm) system może pracować w ciasnych pomieszczeniach.

Dane techniczne

Rozdzielczość:	2448 x 2050
Mierzona objętość w mm ³ :	Mierzone pole 45: 45x38x30
	Mierzone pole 75: 74x62x45
	Mierzone pole 100: 118x98x60
	Mierzone pole 250: 255x211x140
	Mierzone pole 500: 481x404x250



ZEISS T-SCAN

ręczny skaner 3D

T-SCAN jest to skaner ręczny, laserowy. Występuje w 2 konfiguracjach mierzących objętości pomiarowe do 6,5 m³(z trakerem ZEISS T-TRACK CS+) oraz do 30 m³(z trakerem ZEISS T-TRACK LV).

Obszary zastosowań: kontrola jakości w obszarze nominalna, kontrola złożonych konstrukcji spawanych, zbieranie danych 3D do szybkiego prototypowania, inżynieria odwrotna, dokumentacja dzieł sztuki, technika medyczna (analiza ruchu, itd.)

ZEISS O-SELECT

cyfrowy projektor pomiarowy

Urządzeniem można łatwo i niezawodnie zmierzyć nieznaną część bez planu pomiarowego. W tym celu system identyfikuje cechy takie jak np. okręgi i proste, a operator wybiera właściwe. O-SELECT ułatwia też pomiary części o znanych parametrach oraz pomiary seryjne. System automatycznie identyfikuje obiekt i wczytuje odpowiedni, uprzednio przygotowany program pomiarowy. Następnie automatycznie wykonuje zorientowanie części, dobiera właściwą płaszczyznę ogniskowania, ostrość oraz optymalne podświetlenie.



Dane techniczne

Wymiary: 402 x 510 x 727 mm
(szer. x dł. x wys.)

Zakres pomiarowy:
114 x 91,5 mm

ZEISS Stemi 508

mikroskop stereoskopowy



ZEISS Stemi 508 mikroskop stereoskopowy. Posiada zintegrowane oświetlenie z możliwością użycia technik mieszanych. Układ ciągłej zmiany powiększenia umożliwia wygodną pracę ze zróżnicowanym powiększeniem i polem widzenia. Wiele możliwości konfiguracji pozwala na zastosowanie mikroskopu w większości aplikacji materiałoznawczych (statywy z wysięgnikiem, oświetlacze do specjalnych technik obserwacji, precyzyjne stoliki ślizgowe, mechaniczne i polaryzacyjne).

Dane techniczne

System optyczny: Greenough

Korekcja: apochromatyczna

Zoom: 8:1

Zakres powiększeń: 1,9x...250x

Odległość robocza: 92mm

ZEISS Axio Vert.A1 MAT

mikroskop odwrócony materiałograficzny



Mikroskop ZEISS Axio Vert.A1 to kompaktowy mikroskop odwrócony, do rutynowych badań przy użyciu klasycznych technik obserwacyjnych, w świetle odbitym i przechodzącym. W połączeniu z kamerą cyfrową i oprogramowaniem materiałowym mikroskop umożliwia analizę wielkości ziaren, składników fazowych, grubości warstw, czy też interaktywne pomiary charakterystycznych struktur.

Dane techniczne:

- 5-pozycyjny rewolwer obiektywowy do jasnego i ciemnego pola
- Oświetlenie microLED lub halogenowe 50W lub 100W
- Optyka korygowana na nieskończoność
- Techniki obserwacji: jasne pole, ciemne pole, kontrast DIC lub C-DIC, polaryzacja

ZEISS SmartZoom 5

mikroskop cyfrowy



Smartzoom 5 to w pełni apochromatyczny system cyfrowy służącym do inspekcji jakościowych i pomiarów ilościowych. Posiada zmotoryzowany układ zmiany powiększenia oraz zmotoryzowany stolik. System zaopatrzony jest w dwie kamery: przeglądową główną. Pozyskany obraz kalibrowany jest przez oprogramowanie. Możliwości analityczne oprogramowania obejmują algorytmy EDF (poszerzonej głębi ostrości), 3D (rekonstrukcja 3D), mozaikę (poszerzone pole widzenia), szeregi czasowe, segmentowanie itp.. Głowica optyczna osadzona jest na uchylnym statywie. Kąt pochylenia głowicy jest kodowany, co umożliwia automatyczne obliczanie punktu obrotu (zachowywanie pola widzenia bez względu na ustawienie kątowne obiektywu).

Dane techniczne

Zoom: 10:1

Zakres powiększeń: do 1011x

Odległość robocza: 30mm

Obiektywy: APO Z 0,5x; 1,6x; 5,0x;